

## 修正されたブリストアテスト法を用いた ウェハレベル接合の強度評価

by M. Rabold et al.

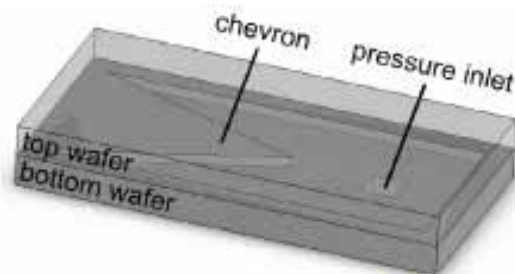


Fig. 2 the modified non-destructive blister test

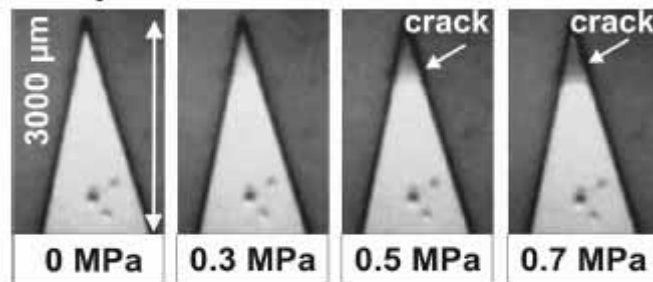


Fig. 9 deterministic crack generation at the chevron

破壊的なブリストアテストを修正した非破壊のブリストアテスト法が提案された。これは、接合面の制御されたクラック発生に基づくテストである。

## マイクロブラシ プレスオン コンタクト

by S.H. Lee et al.

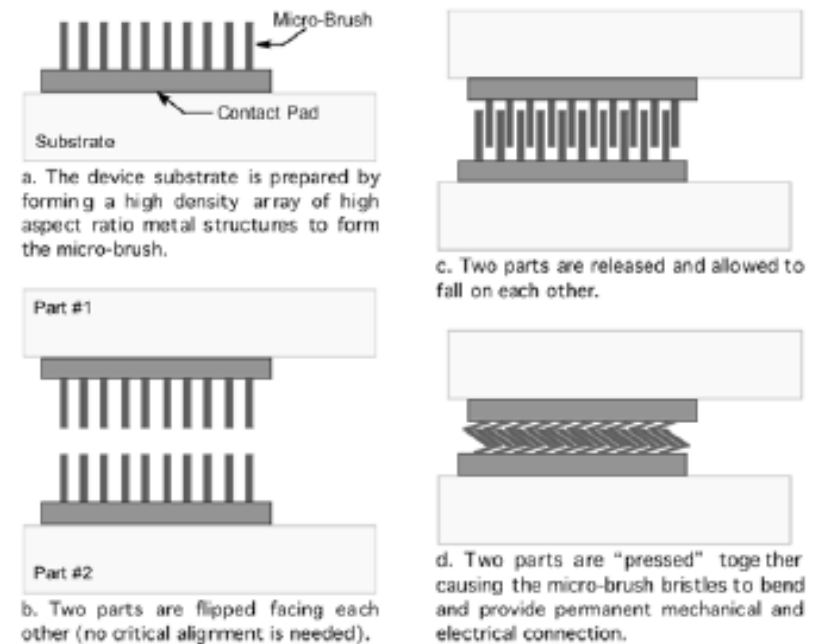


Figure 1: Side views of the micro-brush press-on connection technique.

図1に示すように、デバイス基板に、高密度で、高アスペクト比の金属円柱(マイクロブラシ)を形成し、2つのデバイスを向き合わせて、押し付けると、室温で、電気的な接続と機械的な接続の両方を実現できる。